Устойчивость к электронному облучению высоковольтных 4*H*-SiC диодов Шоттки в рабочем диапазоне температур

© А.А. Лебедев¹, В.В. Козловский², М.Е. Левинштейн¹, Д.А. Малевский¹, Р.А. Кузьмин¹

¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

² Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

195251 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: melev@nimis.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 19 мая 2022 г. В окончательной редакции 30 мая 2022 г. Принята к публикации 30 мая 2022 г.

Впервые исследовано влияние облучения электронами с энергией 0.9 МэВ на параметры 4*H*-SiC диодов Шоттки с предельным блокирующим напряжением $U_b = 600$ и 1700 В в диапазоне рабочих температур T_i (23 и 175°C). Диапазон флюенсов Ф составлял $1 \cdot 10^{16} - 2 \cdot 10^{16}$ см⁻² для приборов с $U_b = 600$ В и $5 \cdot 10^{15} - 1.5 \cdot 10^{16}$ см⁻² для приборов с $U_b = 1700$ В. Облучение при комнатной температуре значительно увеличивает дифференциальное сопротивление базы диодов. Облучение теми же дозами при $T_i = 175^{\circ}$ C — предельной рабочей температуре приборов практически не сказывается на параметрах вольтамперных характеристик. Тем не менее DLTS-спектры демонстрируют значительное увеличение концентрации глубоких уровней в верхней половине запрещенной зоны не только после облучения при комнатной температуре, но и после облучения при $T_i = 175^{\circ}$ C.

Ключевые слова: карбид кремния, диоды Шоттки, электронное облучение, вольт-амперные характеристики, DLTS-спектры.

DOI: 10.21883/FTP.2022.08.53150.9891

1. Введение

Высоковольтные карбид-кремниевые интегрированные (JBS) диоды Шоттки с блокирующим напряжением $U_b = 600$ и 1700 В сделались в настоящее время важными компонентами современной электроники. Они используются в автомобильной и аэрокосмической электронике, компенсаторах реактивной мощности, конверторах солнечных батарей большой площади, импульсных источниках питания, оборудовании ядерных электростанций и т.д. [1–5]. Радиационная устойчивость приборов на основе карбида кремния к различным типам излучения нередко служит важным критерием, определяющим возможность применения соответствующих электронных компонентов в космической и авиационной электронике, оборудовании ядерных реакторов и в ускорителях заряженных частиц.

Влияние облучения электронами с энергиями в диапазоне ~ 0.25–10 МэВ на свойства карбида кремния и приборов на его основе исследовалось в целом ряде работ (см., например, [6–10] и ссылки в них). Во всех этих работах облучение проводилось при комнатной температуре. Недавно в работах [11–13] было исследовано влияние температуры облучения электронами 4*H*-SiC JBS диодов с блокирующим напряжением 1700 В при температурах $T_i = 300$ и 500°C, значительно превосходящих предельную рабочую температуру диодов. Показано, что радиационная стойкость приборов монотонно возрастает с ростом температуры облучения. Продемонстрировано, что при высокотемпературном ("горячем") облучении возникают дефекты, отсутствующие при облучении при комнатной температуре.

Однако температуры, при которых в [11–13] исследовано влияние горячего облучения на свойства 4*H*-SiC JBS структур, значительно превосходят допустимую предельную рабочую температуру диодов Шоттки с блокирующим напряжением $U_b = 600$ и 1700 В (175°C) [14,15].

В настоящей работе сопоставлено влияние облучения электронами с энергией 0.9 МэВ, проведенного при комнатной температуре и предельной рабочей температуре, на параметры 4*H*-SiC JBS с блокирующим напряжением $U_b = 600$ и 1700 В.

2. Условия эксперимента

Исследовались диоды Шоттки СРW3-0600S002.0 с блокирующим напряжением 600 В (среднее значение выпрямленного тока 2 A) [14] и диоды СРW3-1700-S010B-WP с блокирующим напряжением 1700 В и средним значением выпрямленного тока 10 A [15]. Облучение проводилось электронами с энергией 0.9 МэВ в импульсном режиме при длительности импульсов 330 мкс и частоте следования импульсов 490 Гц. Радиационные дефекты генерировались в базе структур с высокой степенью однородности [11–13]. Облучение диодов проводилось в специально сконструированной мишенной камере на воздухе. Ускоренные электроны выводились из вакуумного объема ускорителя через титановую фольгу толщиной ~ 50 мкм. Точность поддержания температуры составляла $\pm 5^{\circ}$ С. Изотермические вольт-амперные характеристики диодов измерялись при комнатной температуре в режиме одиночных импульсов.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлены прямые вольт-амперные характеристики диода с блокирующим напряжением 600 В. Кривая I соответствует I-V-характеристике исходного (необлученного) диода СРW3-0600S002.0 в области относительно больших смещений. При небольших прямых смещениях, в области экспоненциальной части I-V-характеристики электронное облучение оказывает незначительное влияние на параметры вольт-амперных характеристик [10–12].

Измеренное значение дифференциального сопротивления базы R_d в необлученном диоде составляет 0.076 Ом. В результате облучения электроны из зоны проводимости захватываются на генерируемые акцепторные центры, что приводит к возрастанию сопротивления базы. Облучение флюенсом $\Phi = 1 \cdot 10^{16}$ см⁻² при комнатной температуре приводит к росту R_d в 1.9 раза, до величины $R_d \approx 0.145$ Ом; после облучения флюенсом $\Phi = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻² величина R_d составила ≈ 0.35 Ом, т.е. возросла в ~ 4.6 раза. Исходное значение концентрации n_0 равняется $\approx 10^{16}$ см⁻³ [16]. При одинаковой величине подвижности в облученном и исходном диодах [17] скорость удаления электронов из базы диода под влиянием



Рис. 1. Прямые вольт-амперные характеристики диода с блокирующим напряжением 600 В. *I* — исходная *I*–*V*-характеристика, *2* — после облучения электронами флюенсом $\Phi = 1 \cdot 10^{16} \text{ сm}^{-2}$ при комнатной температуре (23°C), *3* — после облучения при комнатной температуре электронами флюенсом $\Phi = 2 \cdot 10^{16} \text{ сm}^{-2}$, *4* — после облучения электронами флюенсом $\Phi = 2 \cdot 10^{16} \text{ сm}^{-2}$ при температуре 175°C. На вставке показана вольт-амперная характеристики диода после облучения флюенсом $\Phi = 3 \cdot 10^{16} \text{ сm}^{-2}$ при 23°C.



Рис. 2. DLTS-спектры образца с блокирующим напряжением $U_b = 600$ В, облученного дозой $\Phi = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻². *I* — температура облучения $T_i = 23^{\circ}$ С, $2 - T_i = 175^{\circ}$ С. Окно скоростей (rate window) — 51 c^{-1} . Амплитуды максимумов в необлученном образце ($\Phi = 0$) во всем диапазоне температур значительно меньше амплитуды максимумов после облучения.

облучения, η_e , составляет для обоих значений флюенса $\eta_e = (n_0 - n)/\Phi \approx 0.4 \text{ см}^{-1}$. Здесь n — концентрация после облучения соответствующей дозой. Это значение несколько больше, чем величина $\eta_e = 0.25 \text{ см}^{-1}$, установленное в работах [18,19], но заметно меньше, чем величина $\eta_e = 1.67 \text{ см}^{-1}$, измеренная в работе [9].

Следует заметить, что при $\eta_e = 0.4 \text{ см}^{-1}$ концентрация электронов в базе *n* при флюенсе $\Phi = 2.5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ формально становится равной нулю. Такая ситуация соответствует условию, когда облучение создает в запрещенной зоне полупроводника акцепторные центры, суммарная концентрация которых равняется исходной концентрации электронов в базе *n*₀. При таком и бо́льших значениях Φ малая остаточная концентрация электронов в базе определяется тепловой генерацией с достаточно глубоких уровней [7,8,20]. Действительно, при облучении образцов при 23°С флюенсом $\Phi = 3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ сопротивление базы R_d составило $\approx 2 \cdot 10^4$ Ом (см. вставку к рис. 1).

Кривая 4 представляет I-V-характеристику диода после облучения флюенсом $\Phi = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻² при температуре $T_i = 175^{\circ}$ С. Дифференциальное сопротивление базы R_d составило в этом случае 0.084 Ом. Таким образом, сопротивление возросло по сравнению с сопротивлением необлученного диода на $\approx 10\%$. Вполне очевидно, что увеличение температуры T_i , при которой производится облучение, радикально увеличивает радиационную стойкость диодов даже при температуре облучения в пределах допустимой рабочей температуры.

На рис. 2 показаны DLTS-спектры, регистрирующие уровни в верхней половине запрещенной зоны.

Обозначения максимумов на DLTS-спектрах соответствует классификации, принятой в работе [10]. За-

811

метим, что в [10] исследовались DLTS-спектры после облучения при комнатной температуре электронами с близким значением энергии (1.05 МэВ) 4H-SiC JBS диодов с блокирующим напряжением 1700 В. Тем не менее температурное положение наблюдающихся после облучения при комнатной температуре DLTS-пиков (рис. 2) вполне удовлетворительно согласуется с положением соответствующих пиков, наблюдавшихся в работе [10]. Определенные из DLTSизмерений концентрации акцепторных уровней составляют $N_t^{E2} = 1.4 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $N_t^{E3} = 1.02 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $N_t^{E1/S1} = 3.7 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ и $N_t^{E0/E1} = 2.35 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ для пиков E2, E3, E1/S1 и E0/E1 соответственно. "Двойные" обозначения пиков E1/S1 и E0/E1 обусловлены тем, что при относительно большом значении флюенса $\Phi = 2 \cdot 10^{16} \, \mathrm{cm}^{-2}$ неизбежное уширение линий приводит к частичному перекрытию и слиянию близко расположенных пиков. Кроме того, как отмечается в [10], при облучении наблюдается некоторый сдвиг положения пиков относительно зоны проводимости вследствие образования в небольшой концентрации политипа 3С, имеющего меньшую ширину запрещенной зоны.

При оценке полной концентрации акцепторных уровней, созданных облучением, необходимо принять во внимание существование уровня *EH6/7*, наблюдающегося в DLTS спектрах при характерной температуре ~ 570 K [7,10]. Для исследуемых образцов во избежание спонтанного отжига [8] максимальная температура при измерении DLTS-спектров составляла 400 K. На контрольных образцах DLTS-спектры исследовались вплоть до температуры ~ 630 K. Концентрация уровня *EH6/7* была найдена равной $\approx 10^{14}$ см⁻³. Таким образом, суммарная концентрация акцепторных центров, , наблюдающихся в верхней половине запрещенной зоны при облучении при комнатной температуре флюенсом $\Phi = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻², составила $N_t^{\Sigma} \approx 4 \cdot 10^{14}$ см⁻³.

Исходя из этого можно было бы ожидать, что сопротивление базы диода возрастет в результате облучения только на $\sim 4\%$. Между тем сопротивление базы R_d возрастает при том же флюенсе в ~ 4.6 раза. Следует, по-видимому, предположить, что, помимо уровней в верхней половине запрещенной зоны, электронное облучение создает акцепторные уровни и в нижней половине запрещенной зоны.

При облучении при температуре $T_i = 175^{\circ}$ С (кривая 2 на рис. 2) пик с максимальной амплитудой, наблюдающийся при $T \approx 330$ К, идентифицируется как уровень Z1/Z2. Концентрация уровня $N_t^{Z2/Z2}$ составляет $\sim 5 \cdot 10^{13}$ см⁻³. Концентрации уровней, соответствующих максимумам при температурах T = 220, 185 и 171 К, составляют $N_{t220} \approx 5 \cdot 10^{12}$, $N_{t185} \approx 4.2 \cdot 10^{12}$, $N_{t171} \approx 9 \cdot 10^{12}$ см⁻³ соответственно. Принимая концентрацию уровня EH6/7 равной концентрации Z1/Z2 [7,21], суммарную концентрацию N_t^{Σ} акцепторных уровней, созданных облучением в верхней половине запрещенной зоны при $T_i = 175^{\circ}$ С, можно



Рис. 3. Прямые вольт-амперные характеристики диода с блокирующим напряжением 1700 В. I — исходная I-V-характеристика, 2 — после облучения электронами флюенсом $\Phi = 5 \cdot 10^{15}$ см⁻² при комнатной температуре, 3 — после облучения при комнатной температуре электронами флюенсом $\Phi = 1.5 \cdot 10^{16}$ см⁻², 4 — после облучения электронами флюенсом $5 \cdot 10^{15}$ см⁻² при температуре 175°С. На вставке показаны DLTS-спектры образца с блокирующим напряжением $U_b = 1700$ В, облученного дозой $\Phi = 5 \cdot 10^{15}$ см⁻². I — температура облучения $T_i = 23^{\circ}$ С, 2 — $T_i = 175^{\circ}$ С. Окно скоростей — 51 с⁻¹. Амплитуды максимумов в необлученном образце ($\Phi = 0$) во всем диапазоне температур значительно меньше амплитуды максимумов после облучения.

оценить, как $N_t^{\Sigma} \approx 1.2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$. При такой величине следовало бы ожидать возрастания сопротивления R_d на ~ 1.2%. Между тем, как видно из рис. 1, R_d возрастает в этом случае на ~ 10%, т.е. в 7 раз сильнее.

Качественно сходные результаты получены при исследовании влияния облучения на диоды с блокирующим напряжением $U_b = 1700 \text{ B}$ (рис. 3).

Измеренное значение дифференциального сопротивления базы R_d в необлученном диоде составляет 0.08 Ом. После облучения флюенсом $\Phi = 5 \cdot 10^{15}$ см⁻² при комнатной температуре величина R_d составила 0.145 Ом (возрастание в ~ 1.8 раза). После облучения флюенсом $\Phi = 1.5 \cdot 10^{16}$ см⁻² величина R_d составила ≈ 0.23 Ом (возрастание в ~ 2.9 раза). Исходное значение концентрации n_0 в исследуемых структурах равняется $3.4 \cdot 10^{15}$ см⁻² (10,13]. Таким образом, для дозы $\Phi = 1.5 \cdot 10^{16}$ см⁻² скорость удаления электронов η_e составляет $\eta_e \approx 0.15$ см⁻¹. Это значение совпадает с величиной η_e , получениой для диодов того же типа в работе [10] при облучении электронами с близкой величиной энергии 1.05 МэВ.

После облучения флюенсом $5 \cdot 10^{15}$ см⁻² при температуре 175°С (кривая 4 на рис. 3) вольт-амперная характеристика с экспериментальной точностью совпадает с I-V-характеристикой исходного необлученного образца. Тем не менее DLTS-спектры, регистрирующие уровни

в верхней половине запрещенной зоны (см. вставку к рис. 3), демонстрируют существенные изменения в амплитуде соответствующих пиков не только после облучения при комнатной температуре, но и в результате облучения при температуре 175°С (см. вставку к рис. 3).

Как можно видеть из сравнения вставки к рис. 3 с данными, приведенными на рис. 2, DLTS-спектры в обоих случаях весьма похожи. Как отмечалось выше, положения пиков вполне удовлетворительно согласуются также с данными, приведенными в работе [10] для тех же диодов CPW3-1700-S010B, облученных электронами с энергией 1.05 МэВ флюенсом $\Phi = 1.2 \cdot 10^{15} \, \mathrm{cm}^{-2}$ при комнатной температуре. Так, температурное положение пиков E2, E3 и E0/E1 на вставке к рис. 3 (кривая 1) соответствует значениям 290, 345 и 160 К соответственно. В работе [10] соответствующие значения температур для этих пиков составляют 260, 310 и 160 К соответственно. Некоторая разница в положении максимумов объясняется, как указывалось выше, неизбежным уширением и частичным перекрытием линий при значительном увеличении флюенса.

При облучении при $T_i = 175^{\circ}$ С (кривая 2) пик с максимальной амплитудой при T = 317 К соответствует уровню Z1/Z2 с концентрацией $N_{t317} \approx 1.2 \cdot 10^{13}$ см⁻³. Концентрации двух других уровней со значительно меньшей амплитудой, наблюдающихся при температурах T = 180 и 212 К, составляют $N_{t180} \approx 8 \cdot 10^{11}$ и $N_{t212} \approx 7.5 \cdot 10^{11}$ см⁻³. Считая концентрацию на уровне EH6/7 приблизительно равной $N_{Z1/Z2} \approx 1.2 \cdot 10^{13}$ см⁻³, найдем, что суммарная концентрация акцепторных центров, N_t^{Σ} , наблюдающихся в верхней половине запрещенной зоны при облучении при $T_i = 175^{\circ}$ С флюенсом $\Phi = 5 \cdot 10^{15}$ см⁻², составила $N_t^{\Sigma} \approx 2.6 \cdot 10^{13}$ см⁻³, т.е. < 1% от исходной концентрации электронов в необлученном образце $n_0 = 3.4 \cdot 10^{15}$ см⁻³.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности радикального улучшения радиационной стойкости высоковольтных карбид-кремниевых диодов Шоттки по отношению к электронному облучению при поддержании повышенной температуры облучаемых диодов в пределах рабочего диапазона температур.

4. Заключение

Впервые исследовано влияние облучения электронами с энергией 0.9 МэВ, проведенного в рабочем диапазоне температур, на параметры высоковольтных 4*H*-SiC диодов Шоттки. Продемонстрировано, что облучение флюенсом, приводящим к изменению сопротивления базы в несколько раз при облучении при комнатной температуре, практически не сказывается на сопротивлении базы при облучении тем же флюенсом при предельной рабочей температуре (175°C). Тем не менее DLTS-измерения демонстрируют весьма заметный рост амплитуды пиков, соответствующих вводимым облучением акцепторным центрам. Установлено, что в случаях, когда критическим параметром является радиационная стойкость, нагрев во время облучения до относительно невысокой температуры может кардинально повысить радиационную стойкость приборов.

Финансирование работы

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РНФ № 22-12-00003.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] R. Singh. Microelectronics Reliability, 46(5-6), 713 (2006).
- [2] T. Nakamura, M. Sasagawa, Y. Nakano, T. Otsuka, M. Miura. Int. Power Electronics Conf. (IPEC 2010), (Sapporo, Japan, June 21–24, 2010).
- [3] Q. Zhang, R. Callanan, M.K. Das, S. Ryu, A.K. Agarwal, J.W. Palmour. IEEE Trans. Power Electron., 25 (12), 2889 (2010).
- [4] B.J. Baliga. 76th Device Research Conf. (DRC 2018), (Santa Barbara, California, USA, June 24–27, 2018) p. 31. doi: 10.1109/drc.2018.8442172
- [5] А.А. Лебедев, П.А. Иванов, М.Е. Левинштейн, Е.Н. Мохов, С.С. Нагалюк, А.Н. Анисимов, П.Г. Баранов. УФН, 189 (8), 803 (2019).
- [6] T. Dalibor, G. Pensl, H. Matsunami, T. Kimoto, W.J. Choyke, A. Schoner, N. Nordell. Phys. Status Solidi A, 162, 199 (1997).
- [7] H. Kaneko, T. Kimoto. Appl. Phys. Lett., 98, 262106 (2011).
- [8] A. Castaldini, A. Cavallini, L. Rigutti, F. Nava. Appl. Phys. Lett., 85, 3780 (2004).
- [9] E. Omotoso, W.E. Meyer, F.D. Auret, A.T. Paradzah, M. Diale, S.M.M. Coelho, P.J. Janse van Rensburg. Mater. Sci. Semicond. Process., 39, 112 (2015).
- [10] P. Hazdra, Jan Vobecký. Phys. Status Solidi A, 216, 1900312 (2019).
- [11] A.A. Lebedev, V.V. Kozlovski, M.E. Levinshtein, A.E. Ivanov, K.S. Davydovskaya, V.S. Yuferev, A.V. Zubov. Radiation Phys. Chem., 185, 109514 (2021).
- [12] A. A. Lebedev, V.V. Kozlovski, K.S. Davydovskaya, M.E. Levinshtein. Materials, 14, 4976 (2021). https://doi.org/10.3390/ma14174976
- [13] А.А. Лебедев, В.В. Козловский, М.Е. Левинштейн, Д.А. Малевский, Г.А. Оганесян, А.М. Стрельчук, К.С. Давыдовская. ФТП, 56 (4), 441 (2022).
- [14] https://datasheetspdf.com/datasheet/CPW3-0600S002.html
- [15] https://datasheetspdf.com/datasheet/CPW3-1700S010.html
- [16] P.A. Ivanov, M.E. Levinshtein. Microelectron. Reliab., 122, 114159 (2021).
- [17] M.E. Levinshtein, S.L. Rumyantsev, M.S. Shur (eds). Properties of Advanced Semiconductor Materials: GaN, AIN, InN, BN, SiC, SiGe (John Wiley & Sons, Inc., N.Y., 2001).
- [18] В.В. Козловский, А.А. Лебедев, В.Н. Ломасов, Е.В. Богданова, Н.В. Середова. ФТП, 48 (8), 1033 (2014).
- [19] V.V. Kozlovski, A.A. Lebedev, E.V. Bogdanova. J. Appl. Phys., 117, 155702 (2015).

[20] J. Vobecký, P. Hazdra, S. Popelka, R.K. Sharma. IEEE Trans. Electron Dev., 62 (6), 1964 (2015).

[21] K. Danno, T. Kimoto. J. Appl. Phys., 100, 113728 (2006).

Редактор Г.А. Оганесян

Electron irradiation hardness of high-voltage 4*H*-SiC Schottky diodes in the operating temperature range

A.A. Lebedev¹, V.V. Kozlovski², M.E. Levinshtein¹, D.A. Malevsky¹, R.A. Kuzmin¹

¹ Ioffe Institute,
194021 St. Petersburg, Russia
² Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
195251 St. Petersburg, Russia

Abstract Effect of irradiation with 0.9 MeV electrons on the parameters of 4*H*-SiC Schottky diodes with a limiting blocking voltage U_b of 600 and 1700 V was studied for the first time in the range of operating temperatures T_i (23 and 1750°C). The range of fluences Φ was $1 \cdot 10^{16} - 2 \cdot 10^{16}$ cm⁻² for devices with $U_b = 600$ V and $5 \cdot 10^{15} - 1.5 \cdot 10^{16}$ cm⁻² for devices with $U_b = 1700$ V. Irradiation at room temperature increases significantly the differential resistance of the base of the diodes. Irradiation with the same doses at $T_i = 175^{\circ}$ C i.e. at limiting operating temperature of devices, does not affect practically the parameters of current-voltage characteristics. Nevertheless, the DLTS spectra demonstrate a significant increase in the concentration of deep levels in the upper half of the band gap not only after irradiation at room temperature, but also after irradiation at $T_i = 175^{\circ}$ C.